

日本国特許庁
PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

11:062 U.S. PTO
09/652150
06/31/2000

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日
Date of Application: 1999年10月29日

出願番号
Application Number: 平成11年特許願第308312号

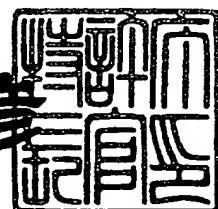
出願人
Applicant(s): ソニー株式会社

CERTIFIED COPY OF
PRIORITY DOCUMENT

2000年 6月29日

特許庁長官
Commissioner,
Patent Office

近藤 隆



出証番号 出証特2000-3052273

【書類名】 特許願
【整理番号】 9900781505
【提出日】 平成11年10月29日
【あて先】 特許庁長官 殿
【国際特許分類】 H04N 5/335
【発明者】
【住所又は居所】 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社
内
【氏名】 星野 和弘
【特許出願人】
【識別番号】 000002185
【氏名又は名称】 ソニー株式会社
【代表者】 出井 伸之
【代理人】
【識別番号】 100086298
【弁理士】
【氏名又は名称】 船橋 國則
【電話番号】 046-228-9850
【手数料の表示】
【予納台帳番号】 007364
【納付金額】 21,000円
【提出物件の目録】
【物件名】 明細書 1
【物件名】 図面 1
【物件名】 要約書 1
【包括委任状番号】 9904452
【ブルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 撮像素子、撮像装置、カメラモジュール及びカメラシステム

【特許請求の範囲】

【請求項1】 一方の面に受光部を有するとともに、前記受光部と反対側の素子裏面に遮光膜を有することを特徴とする撮像素子。

【請求項2】 基板と、

一方の面に受光部を有するとともに、前記基板に対して前記一方の面を対向させた状態でフリップチップ実装され、かつ前記受光部と反対側の素子裏面に遮光膜を有する撮像素子と

を備えることを特徴とする撮像装置。

【請求項3】 透光用の貫通穴が設けられた基板と、

一方の面に受光部を有するとともに、この受光部を前記貫通穴から露出させた状態で前記基板の一方の面にフリップチップ実装され、かつ前記受光部と反対側の素子裏面に遮光膜を有する撮像素子と

を備えることを特徴とする撮像装置。

【請求項4】 前記フリップチップ実装による前記基板と前記撮像素子の接続部を含む素子周辺部において、前記撮像素子の側面と裏面を覆う状態で塗布された黒色の樹脂を有し、この樹脂の一部で前記遮光膜を形成してなることを特徴とする請求項2記載の撮像装置。

【請求項5】 透光用の貫通穴が設けられた基板と、

一方の面に受光部を有するとともに、この受光部を前記貫通穴から露出させた状態で前記基板の一方の面にフリップチップ実装され、かつ前記受光部と反対側の素子裏面に遮光膜を有する撮像素子と、

前記基板の他方の面に実装されたレンズユニットと
を備えることを特徴とするカメラモジュール。

【請求項6】 透光用の貫通穴が設けられた基板と、

一方の面に受光部を有するとともに、この受光部を前記貫通穴から露出させた状態で前記基板の一方の面にフリップチップ実装され、かつ前記受光部と反対側の素子裏面に遮光膜を有する撮像素子と、

前記基板の他方の面に実装されたレンズユニットと
を備えるカメラモジュールを用いた
ことを特徴とするカメラシステム。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、撮像素子とこれを用いた撮像装置、さらには撮像素子を備えるカメラモジュールとこれを用いたカメラシステムに関する。

【0002】

【従来の技術】

近年、撮像素子を用いたカメラモジュールは、信号処理系統を含むカメラシステムとして、パーソナルコンピュータや携帯型テレビ電話などの小型情報端末に搭載される用途が求められ、これに伴ってカメラモジュールの小型化要求が強まっている。

【0003】

従来、CCD撮像素子やCMOS撮像素子などの撮像素子を用いたカメラモジュールとしては、チップ状の撮像素子を中空のパッケージ内に気密封止してなるQFP(Quad Flat Package)タイプの撮像装置を機能デバイスとして用いたものが知られている。このようなカメラモジュールには、上記撮像装置をプリント配線基板等の実装基板に実装するとともに、撮像装置の上部に結像用のレンズユニットを搭載したものが公知となっている。

【0004】

ところで、上記構成のカメラモジュールの場合は、モジュール全体の厚み寸法が、これを構成する撮像装置、実装基板及びレンズユニットの各厚み寸法を足し合わせたものとなる。そのため、カメラモジュールを薄型化するには、各構成部品の厚み寸法を小さくする必要がある。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら現状では、撮像装置、実装基板及びレンズユニットの各厚み寸法

を小さくするにも限界のレベルに達しつつある。したがって、カメラモジュールの更なる薄型化を図ることは極めて困難な状況になっている。

【0006】

これに対して、本出願人は、例えば先に出願した特願平11-249473号明細書において、フリップチップ実装方式（ペアチップ実装方式）による新規なモジュール構造を提案し、これによって超薄型のカメラモジュールを実現している。

【0007】

ところが、先に提案したモジュール構造では、実際に撮像して得られた画像上にゴースト像が現れるという動作上の難点が生じた。

【0008】

そこで本発明者は、ゴースト像の発生要因について検討を重ねた結果、次のような結論を得るに至った。

通常、撮像素子は受光部やレンズが存在する素子表面から光を検知して光電変換し、これによって得られた画像信号を信号処理回路等に与えてディスプレイ等の画面上に画像を表示させる。先述した従来のカメラモジュールでは、撮像装置の構成として、中空のパッケージ底部に受光部を上向きにして（フェースアップの状態で）撮像素子を搭載している。これに対して、先に提案したモジュール構造では、透光用の貫通穴が設けられた基板に対し、該貫通穴から受光部を露出させた状態で撮像素子をフリップチップ実装（ペアチップ実装）している。そのため、前者の場合は撮像素子の裏面がパッケージにより外部から遮蔽された状態になっているのに対し、後者の場合は撮像素子の裏面が外部に露出した状態となっている。

【0009】

こうした構造上の違いにより、前者の場合は、図10（a）に示すように撮像素子30の裏面31側から入射する光がパッケージ32で遮られるものの、後者の場合は、図10（b）に示すように撮像素子30の裏面31に直に光が入射されることになる。そのような状況において、撮像素子30のベース基板として多用されるシリコン基板（シリコンウエハ等）は、光学的に長波長（赤外領域から

可視光領域の長波長帯)の光を透過する性質をもっている。そのため、後者の場合は撮像素子30の受光部側(表面側)からの入射光だけでなく、素子裏面31から入射した光が素子内部を透過し、この透過光が受光部に到達して感知されることにより、ゴースト像を引き起こしてしまうことが判明した。

【0010】

【課題を解決するための手段】

そこで本発明においては、上記課題解決のための手段として、一方の面に受光部を有する撮像素子の構成として、受光部と反対側の素子裏面に遮光膜を設けた構成を採用している。また、本発明に係る撮像装置においては、基板と、一方の面に受光部を有するとともに、前記基板に対して前記一方の面を対向させた状態でフリップチップ実装され、かつ前記受光部と反対側の素子裏面に遮光膜を有する撮像素子とを備えた構成を採用している。

【0011】

上記構成からなる撮像素子及び撮像装置においては、撮像素子の素子裏面に遮光膜を設けたことにより、この撮像素子をペアチップの状態で基板にフリップチップ実装した場合に、素子裏面に入射する光が遮光膜で遮断されるようになる。これにより、素子裏面からの入射光が素子内部を透過して受光部に感知されることがなくなる。そのため、かかる撮像素子を用いて構成されたカメラモジュールにおいては、素子裏面からの入射光に起因するゴースト像の発生を防止することが可能となる。

【0012】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態について図面を参照しつつ詳細に説明する。

【0013】

図1は本発明に係るカメラシステムの構成を示す側面概略図である。図示したカメラシステム1は、カメラモジュール2とシステムモジュール3によって構成されている。カメラモジュール2とシステムモジュール3とはフレキシブル配線基板4によって繋がれている。フレキシブル配線基板4は、カメラモジュール2側から引き出されたもので、その引き出し端の配線パターン部がコネクタ5を介

してシステムモジュール3の配線パターンに電気的に接続されている。

【0014】

システムモジュール3の配線基板6には、上記コネクタ5とともに各種の電子部品7A～7D及びシステムIC8A～8Cが両面実装されている。システムIC8A～8Cは、カメラモジュール2を駆動するための駆動回路や、カメラモジュール2によって得られる画像信号に種々の画像処理（例えば、画像圧縮処理等）を施す画像処理回路などを構成するものである。また、配線基板6には、システムモジュール3を含めたカメラシステム1をパソコン用コンピュータ等の情報端末に接続するためのUSB（Universal-Serial-Bus）コネクタ9が実装されている。

【0015】

図2は本発明の実施形態に係るカメラモジュールの構造を説明するもので、（a）はその概略平面図、（b）はその側断面図である。図示したカメラモジュール2は、基板10、撮像素子11及びレンズユニット12によって構成されている。

【0016】

基板10は、図3にも示すように、メタルプレート13と先述したフレキシブル配線基板4とを接着剤等（不図示）により貼り合わせたものである。メタルプレート13は、例えば板厚が0.5mm前後の薄いステンレス鋼板からなるもので、撮像素子1の外形寸法よりも大きな正方形又は長方形をなしている。フレキシブル配線基板4は、例えばポリエチルやポリイミドからなるベースフィルムに銅等の導体材料によって配線パターン（不図示）を形成したもので、メタルプレート13とほぼ同一幅をもった長尺状の帯状構造をなしている。そして、このフレキシブル配線基板4の端部にメタルプレート13が貼り付けられ、その貼り付け部分で基板10の強度（剛性）が十分に確保されている。

【0017】

また、基板10には透光用の貫通穴14が設けられている。この貫通穴14は、フレキシブル配線基板4とメタルプレート13の貼り合わせ部分の略中央部に設けられている。また、貫通穴14は、後述する撮像素子4の受光部とほぼ同じ

大きさをもって四角形（矩形状）に開けられている。これに対して、フレキシブル配線基板4の配線パターンの端部は、上記貫通穴14の周辺部に撮像素子11の電極位置に対応して配置されている。

【0018】

なお、メタルプレート13は、後述するように撮像素子11とレンズユニット12を基板10に実装するにあたって、その実装部分を機械的に補強し且つ光軸方向におけるレンズユニット2の位置合わせ精度を確保するためのものである。そのため、フレキシブル配線基板4の厚みを厚くして十分な強度（剛性）が得られる場合には、メタルプレート13を設ける必要はない。また、基板材料としては、基板10の全部又は一部を、ポリイミド系有機材料、ガラスエポキシ系有機材料、或いはセラミック系材料で構成してもよい。ただし、いずれの基板材料を採用する場合でも、撮像素子11との電気的な接続のための配線パターンを設ける必要がある。

【0019】

撮像素子11は、例えばCCD撮像素子、CMOS撮像素子等からなるもので、その主面上に多数の読み取画素を2次元的に配列してなる受光部15を有している。また、撮像素子11の周縁部には、上記受光部15を囲む状態で、例えばアルミニウムパッドからなる複数の電極部（不図示）が形成されている。この撮像素子11は、ペアチップの状態で、バンプ16を介して基板10の一方の面（フレキシブル配線基板4の下面）に実装（フリップチップ実装）され、これによって撮像素子11の電極部（不図示）とフレキシブル配線基板4の配線パターンとがバンプ16を介して電気的に接続されている。また、この実装状態においては、撮像素子11の表面（主面）が基板10に対向しつつ撮像素子11の受光部15が基板10の貫通穴14から露出する状態に配置されている。

【0020】

一方、撮像素子11の受光部15が形成されている側の面（主面）と反対側の面（以下、素子裏面）には、遮光膜22が設けられている。この遮光膜22は、例えばアルミニウムなどの金属膜からなるもので、撮像素子11の裏面全域にわたって形成されている。金属膜による遮光膜22の形成手法としては、真空蒸着

法やスパッタリング法等（詳細は後述）を用いることができる。

【0021】

さらに、撮像素子11の周辺部にはその全周にわたって封止用の樹脂17が塗布されている。この樹脂17は、撮像素子11と基板10の電気的接続部（バンプ接合部）の機械的な強度を高めることと、それらの隙間からの塵埃の進入を阻止する役目を果たす。封止用の樹脂17としては、その特性としてガスの発生が極力少ない樹脂材料、例えばエポキシ樹脂等を用いることが望ましい。その理由は、封止樹脂17から発生したガスが後述するレンズに付着すると、レンズ表面が曇って撮像性能に悪影響を与えるためである。

【0022】

レンズユニット12は、ホルダ18、鏡筒19、光学フィルタ20及びレンズ21によって構成されている。ホルダ18は、円筒構造をなすもので、その内周側に鏡筒19が嵌合されている。ホルダ18の内周面と鏡筒19の外周面には必要に応じてネジ山が形成される。このネジ山を形成してホルダ18と鏡筒19を互いに螺合すれば、両者を中心軸方向（光軸方向）に相対移動させて焦点合わせを行うことができる。鏡筒19の先端部は中心軸側に略直角に曲げ成形され、これによって入射光規制のための絞り部19Aが一体に形成されている。

【0023】

光学フィルタ20は、例えば上記絞り部19Aを介して入射する入射光の中から赤外部をカットする機能を果たす、いわゆる赤外カットフィルタである。この光学フィルタ20は、上記絞り部19Aに近接して鏡筒19の先端寄りに嵌合固定されている。レンズ21は、上記絞り部19A及び光学フィルタ20を介して入射した光を、撮像素子11の受光部15で結像させるためのものである。このレンズ21は、上記絞り部19Aを基準に位置出しを行った状態で、上記光学フィルタ20とともに鏡筒19の内部に取り付けられている。

【0024】

なお、光学フィルタ20は、赤外カットフィルタに限らず、撮像用途に応じて種々のフィルタ（例えば、光学的なバンドパスフィルタなど）を用いることができる。また、レンズ21の材料（硝材）に赤外カット機能をもつ材料を用いたり

、 こうした材料をレンズ21表面にコーティング、蒸着等によって付着させることにより、レンズ21自体に赤外カット機能を持たせることも可能である。こうした場合は、光学フィルタ20に赤外カットフィルタを用いる必要はなくなる。さらに、ホルダ18無しでレンズユニット12を構成することも可能である。

【0025】

上記構成のレンズユニット12は、基板10の他方の面（メタルプレート13の上面）に実装されている。この実装状態では、基板10（13, 4）を間に挟んで、該基板10の両面に撮像素子11とレンズユニット12が実装されている。また、撮像素子11の受光部15とレンズユニット12のレンズ21とは基板10の貫通穴14を介して同じ軸上（光軸上）で対向し、かつ撮像素子11の受光部15上の空間がレンズユニット12で覆われた状態になっている。

【0026】

かかるカメラモジュール2においては、撮像素子11の受光部15が基板10の貫通穴14から露出した状態となっているため、実際の撮像時には、レンズユニット12の絞り部19Aから光学フィルタ20を通して入射した光が、レンズ21の屈折作用により撮像素子11の受光部15で結像することになる。また、撮像素子11の受光部15で受光されかつそこで光電変換によって得られた画像信号は、基板10（フレキシブル配線基板4）の配線パターンを介してシステムモジュール3（図1参照）に伝達される。

【0027】

続いて、本発明の実施形態に係るカメラモジュールの製造方法について説明する。

【0028】

先ず、撮像素子11の製造工程においては、図4（a）に示すように、シリコン基板等からなるウエハ23上に、上記受光部15を含む素子形成層24を形成した後、図4（b）に示すように、ウエハ23の厚みが所定の寸法（例えば、厚さ400μm）となるようにウエハ23の裏面を裏面研磨装置により研磨する。

【0029】

次いで、先ほど研磨したウエハ23の裏面に真空蒸着法によってアルミニウム

を蒸着させ、これによってウエハ23の裏面にアルミニウムによる金属膜25を形成する。このアルミニウムを蒸発材料（成膜材料）とした真空蒸着は、例えば、真空度：1 mTorr、蒸発材料の加熱方式：るつぼ加熱、基板（ウエハ）温度：100°C、蒸発材料の成長膜厚：3 μmといった条件で行われる。その後、ウエハ23を所定のカッティングラインに沿ってダイシングすることにより、素子裏面に遮光膜22（金属膜25）を備えた複数の撮像素子11が得られる。

【0030】

なお、ここでは金属膜（アルミニウム膜）25の形成方法として真空蒸着法を例に挙げたが、これ以外にもスパッタリング法によって同様の金属膜25を形成してもよい。このスパッタリング法による金属膜25の形成条件としては、例えば、ターゲット材料：純アルミニウム、ベース真空度：1.0⁻⁸ mTorr、スパッタリング時の真空度：5 mTorr、導入ガス：アルゴンガス、基板温度：100°C、成長膜厚3 μmといった条件を採用することができる。また、遮光膜22を構成する金属膜25の材料としても、例えば金、銀、タンクステン、モリブデンなどの他の金属を用いるようにしてもよい。

【0031】

一方、基板10の製造工程においては、先の図3に示すように、メタルプレート13とフレキシブル配線基板4を接着剤等を用いて貼り合わせた後、その貼り合わせ部分の略中央部に例えばプレスによる打ち抜き加工等によって貫通穴14を明ける。なお、貫通穴14については、貼り合わせ前のメタルプレート13とフレキシブル配線基板4の双方に予め形成しておいてもよい。

【0032】

このようにして撮像素子11と基板10を用意したら、続いて、図5（a）に示すように、撮像素子11の各々の電極部の上にバンプ16を形成する。バンプ16については、例えば図6（a）に示すようにキャピラリ22の先端から引き出した金線23の先端にボールを形成してこれを撮像素子11の電極部（アルミニウムパッド）11Aに圧着した後、図6（b）に示すようにキャピラリ22から金線23を引き出さずに、ボールの部分で金線23を切断することにより形成することができる。このバンプ形成方法は、ボールバンプ法（又はスタッドバン

プ法)と呼ばれるものであるが、これ以外にも、例えば、無電界めっき法を用いたバンプ形成や、転写バンプ法又はソルダーリング技術を用いたバンプ形成方法を採用してもよい。

【0033】

次に、図5(b)に示すように、基板10の一方の面にバンプ16を介して撮像素子11を実装(フリップチップ実装)する。かかる実装工程では、図示せぬ受台に基板10を載置する一方、図示せぬボンディングツールで撮像素子11を保持する。そして、受台上の基板10とボンディングツールにて保持した撮像素子11を位置合わせした状態で、撮像素子11の電極部に形成したバンプ16を超音波接合により基板10(フレキシブル配線基板4)の配線パターンに電気的かつ機械的に接続する。

【0034】

基板10と撮像素子11の位置合わせは、上記ボンディングツールによる加圧方向と直交する方向(一般的には水平方向)において、基板10の貫通穴14と撮像素子11の受光部15の位置、及び基板10の配線パターンとこれに対応する撮像素子11の電極部の位置が、それぞれ一致する条件で行われる。また、超音波接合については、例えば、周波数:50KHz、ツール温度:100°C、受台温度:100°C、接合時間:0.5s秒、ツール加圧力:バンプ一個当たり100g、振幅2.5μmの条件で行われる。

【0035】

ここで、超音波接合時の加熱温度としては、撮像素子11の主面(受光部15)上にマイクロレンズが形成されている場合にこのマイクロレンズが熱的なダメージを受けないよう、170°C以下の条件に設定することが望ましい。ちなみに、超音波接合方法では130°C程度の温度で処理できるため、マイクロレンズに熱的なダメージを与える虞れはない。ただし、基板10に撮像素子11を実装する際の接合方法としては、上記温度条件(170°C以下)を満たす低温接合を実現するものであれば、超音波接合以外の接合方法を採用しても構わない。具体的には、銀ペーストを用いた接合やインジウムを用いた接合、或いは異方性導電材料を用いた接合方法などが考えられる。

【0036】

次いで、図5(c)に示すように、撮像素子11の周辺部にディスペンサ等を用いて封止用の樹脂(アンダーフィル材)17を塗布する。このとき、適度な粘性を有する樹脂17を用いることにより、ディスペンサ等で塗布した樹脂17が撮像素子11の受光部15にまで流れ込まないようにする。また、樹脂17を塗布した後は、これを自然乾燥或いは熱処理によって硬化させておく。樹脂17の材料としては、例えばフェノールノボラック型のエポキシ樹脂を用いる。また、上記熱処理による硬化条件としては、120°Cで2時間とする。

【0037】

続いて、図5(d)に示すように、予め組み立ての完了したレンズユニット12を基板10の他方の面に実装する。かかる実装工程では、レンズユニット12のホルダ18の端面又はレンズユニット12の実装位置に対応した基板10の他方の面上に、例えばエポキシ系の接着剤(不図示)を塗布する。その後、レンズユニット12と撮像素子11を位置合わせした状態で、基板10の他方の面上にレンズユニット12を押し付けることにより、上記接着剤を介してレンズユニット12を基板10に固定する。以上で、先の図2に示したカメラモジュール2が得られる。

【0038】

ちなみに、撮像素子11の裏面に金属膜による遮光膜22を形成するにあたっては、上述のように撮像素子11の製造工程で真空蒸着法等により形成する以外にも、ウエハ23をダイシングして得られた撮像素子11を基板10に実装した後、或いは基板10にレンズユニット12を実装した後に、例えば撮像素子11の裏面に金属ペースト(銀ペースト等)を塗布することにより、素子裏面に金属膜からなる遮光膜22を形成することも可能である。

【0039】

このようにして得られたカメラモジュール2においては、貫通穴14を有する基板10の一方の面にフリップチップ実装にて撮像素子11を直に取り付け、その反対側、即ち基板10の他方の面にレンズユニット12を実装した構造を採用しているため、従来のモジュール構造に比較して、撮像素子を気密封止するため

のパッケージ厚寸法分を削減できるとともに、モジュール厚み方向において基板10、撮像素子11及びレンズユニット12をより密に配置することができる。これにより、超薄型のカメラモジュール2を提供することが可能となる。また、かかるカメラモジュール2を用いたカメラシステム1においては、カメラモジュール2の厚みが薄くなることで、より小さな取付スペースを利用して情報端末に組み込むことが可能となる。

【0040】

さらに、撮像素子11の裏面に遮光膜22が形成されているため、素子裏面が外部に露出する状態で実装されても、図7に示すように撮像素子11の裏面から入射する光を遮光膜22によって遮断することができる。これにより、素子裏面からの入射光（長波長の光等）が撮像素子11の内部を透過して受光部15に感知されることがなくなる。したがって、実際にカメラモジュール2で撮像した場合でも、素子裏面からの入射光に起因したゴースト像やノイズの発生を防止して良好な画像を得ることが可能となる。

【0041】

また、本実施形態においては、撮像素子11をフレキシブル配線基板4に接続しているため、そのフレキシブル配線基板4の可撓性を利用してカメラモジュール2の向きを自由に変えることができる。これにより、カメラモジュール2を情報端末製品に組み込む際には、カメラモジュール2の取り付け角度を任意に調整可能となるため、組み付け時の自由度が大幅に向上する。

【0042】

さらに、かかるカメラモジュール2を製造するにあたっては、撮像素子11を気密封止するためのパッケージ工程が不要になることから、生産性の向上によって低コスト化を実現することが可能となる。

【0043】

なお、上記実施形態においては、基板10、撮像素子11及びレンズユニット12からなるカメラモジュール2への適用例について説明したが、本発明はこれに限らず、例えば図8（a）に示すように上記レンズユニット12に代えて基板10の貫通穴14をシールガラスや光学フィルタ基板等の光透過性板状部材26

で閉塞してなる撮像装置、或いは図8 (b) に示すように透明なガラス基板（又は光学フィルタ基板等）27に対して撮像素子11をペアチップの状態でフリップチップ実装してなる撮像装置などにも同様に適用可能である。

【0044】

また、上記実施形態においては、撮像素子11の裏面に真空蒸着法等によって金属膜からなる遮光膜22を形成するようにしたが、これ以外にも、例えば撮像素子11の裏面に黒色の樹脂（エポキシ樹脂、シリコーン樹脂等）を塗布して黒色化したり、素子裏面に透明な樹脂膜を形成した後に黒色インクを含有する塗装材料で樹脂膜表面を塗装して黒色化することにより、素子裏面に樹脂製の遮光膜22を形成したものであってもよい。

【0045】

このように樹脂によって遮光膜22を形成する場合にあっては、撮像素子11の製造工程で遮光膜22を形成しなくても、先の図5 (c) に示す処理工程にて撮像素子11の裏面と側面を覆う状態で黒色の樹脂（封止用の樹脂）17を塗布することにより、図9に示すように該樹脂17の一部（素子裏面に対応する部分）17Aで遮光膜22を形成し、かつ該樹脂17の他部（素子側面に対応する部分）17Bで撮像素子11と基板10の接合強度を高めて剥がれ等を防止することができる。

【0046】

【発明の効果】

以上説明したように本発明によれば、撮像素子の構成として受光部と反対側の素子裏面に遮光膜を設けるようにしたので、かかる撮像素子を用いて薄型の撮像装置やカメラモジュールを実現する場合に、素子裏面から入射する光を遮光膜で遮断し、該入射光に起因するゴースト像等の発生を防止することができる。これにより、非常に薄型でしかも高い撮像性能を有する撮像装置やカメラモジュールを提供することが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明に係るカメラシステムの構成を示す側面概略図である。

【図2】

本発明の実施形態に係るカメラモジュールの構造を説明する図である。

【図3】

本発明の実施形態に係るカメラモジュールの基板構造を示す斜視図である。

【図4】

本発明の実施形態に係る撮像素子の製造工程図である。

【図5】

本発明の実施形態に係るカメラモジュールの製造工程図である。

【図6】

バンプ形成方法の一例を説明する図である。

【図7】

本発明の効果を説明する図である。

【図8】

本発明の他の適用例を説明する図である。

【図9】

本発明の他の実施形態を説明する図である。

【図10】

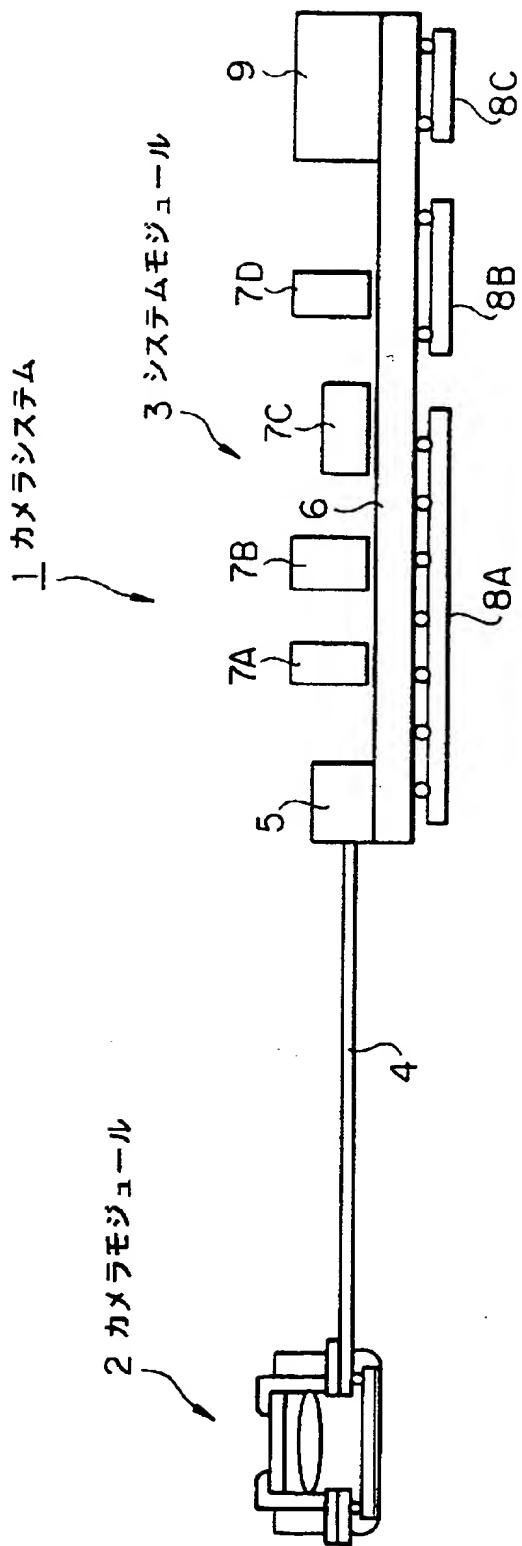
課題を説明するための図である。

【符号の説明】

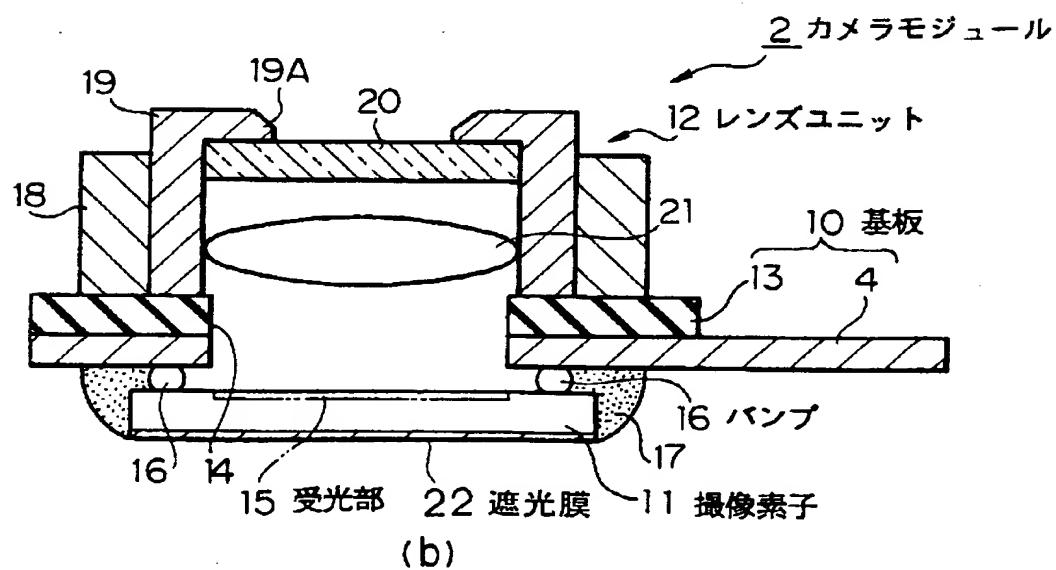
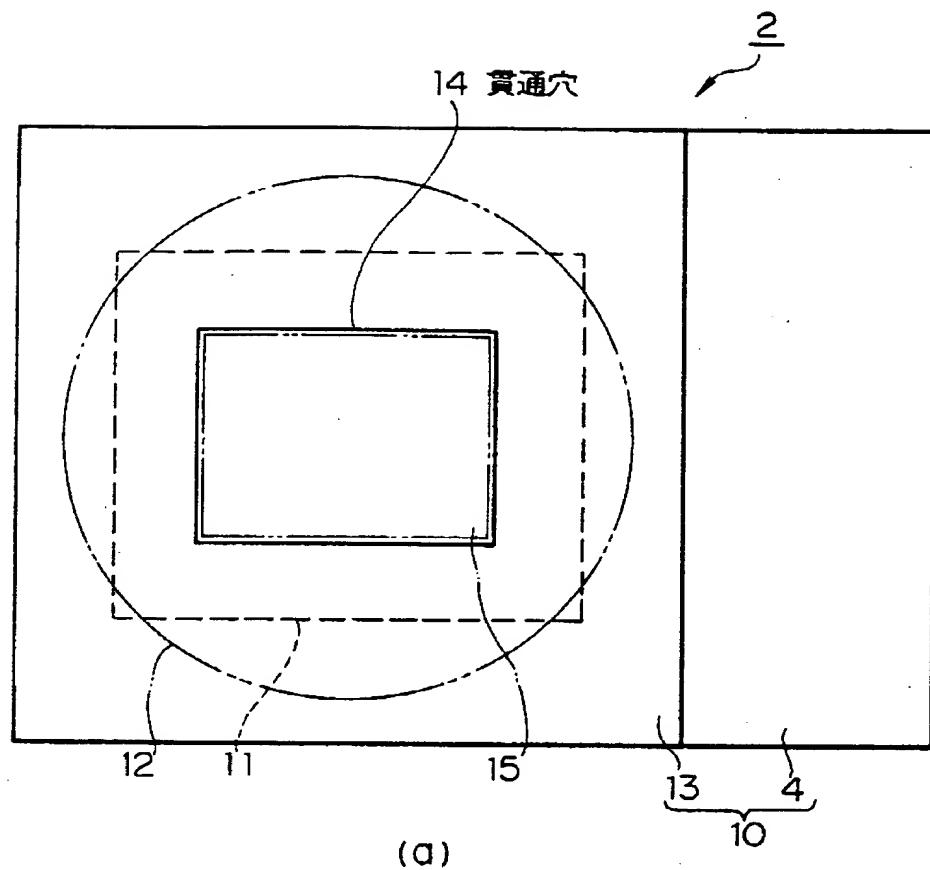
1…カメラシステム、2…カメラモジュール、10…基板、11…撮像素子、
12…レンズユニット、14…貫通穴、15…受光部、16…バンプ、17…樹脂、
22…遮光膜

【書類名】 図面

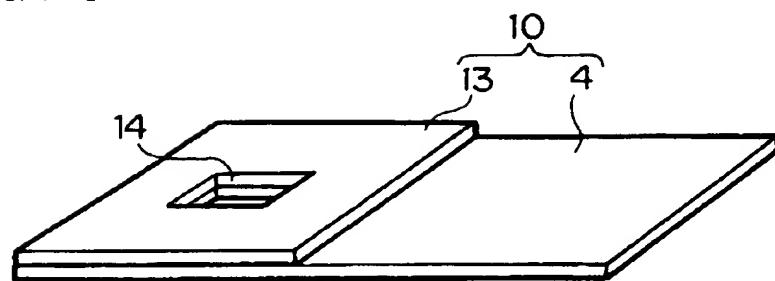
【図1】



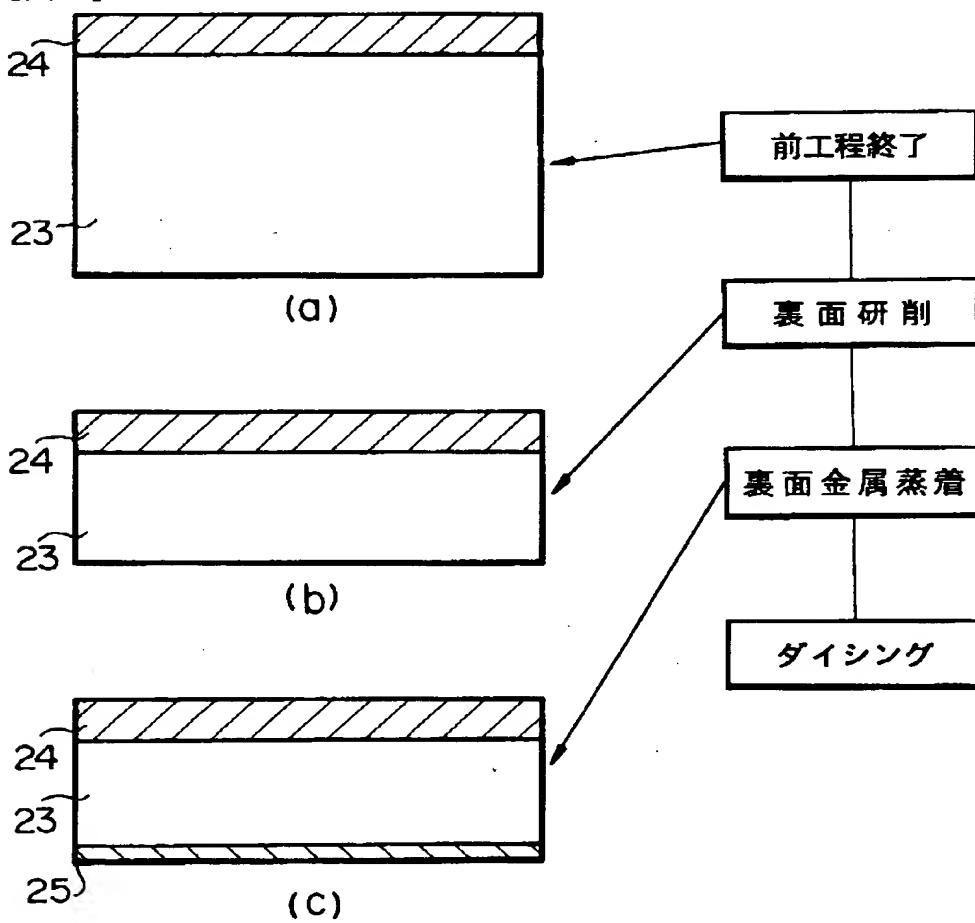
【図2】



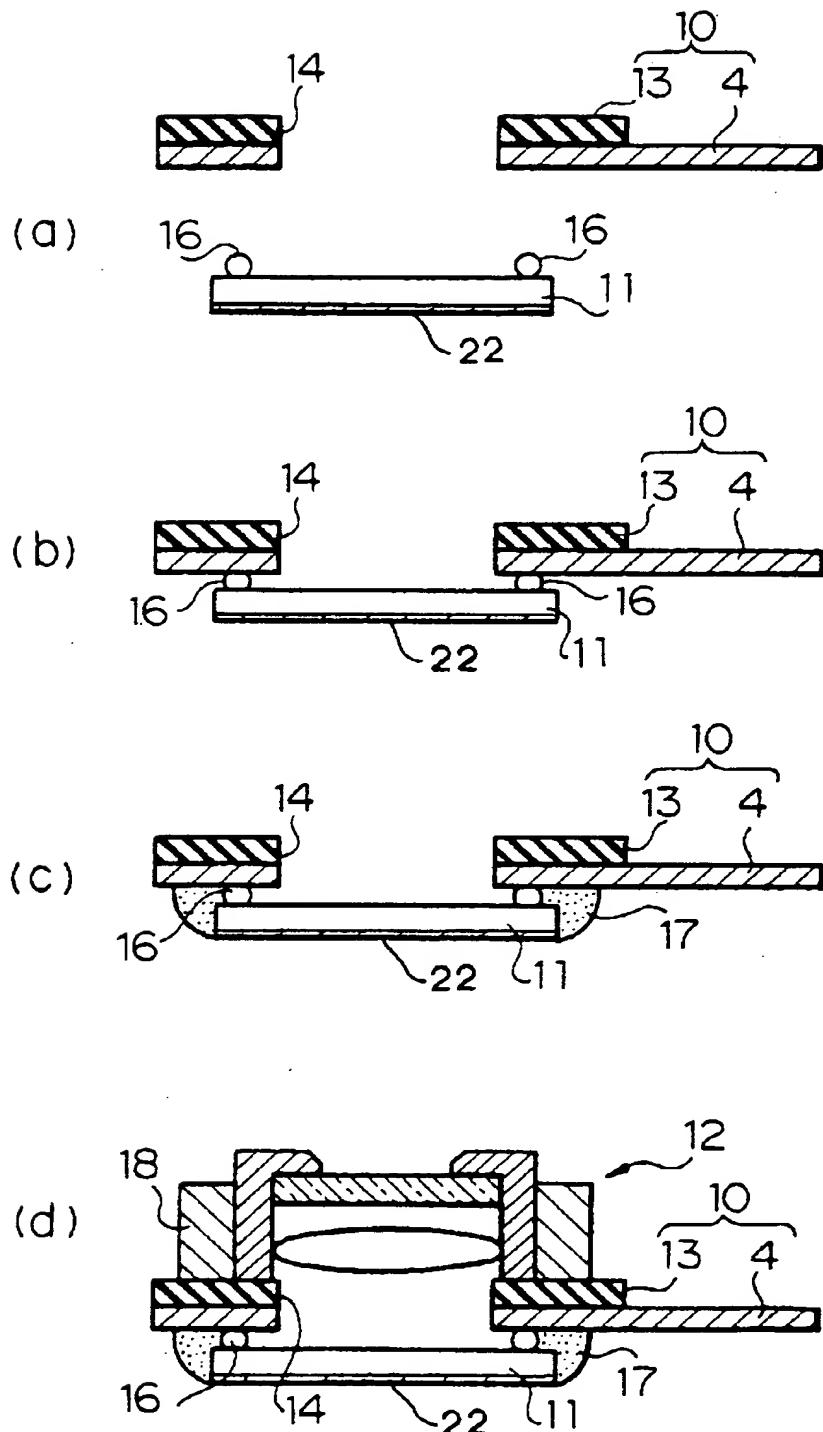
【図3】



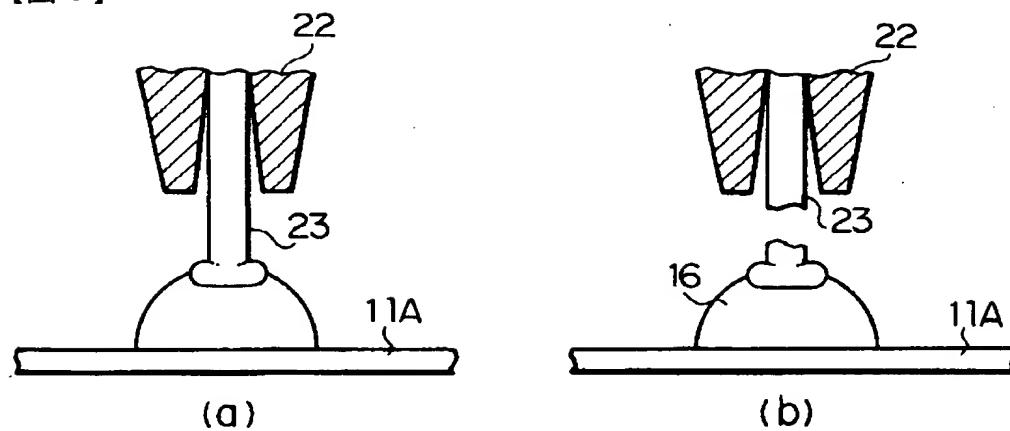
【図4】



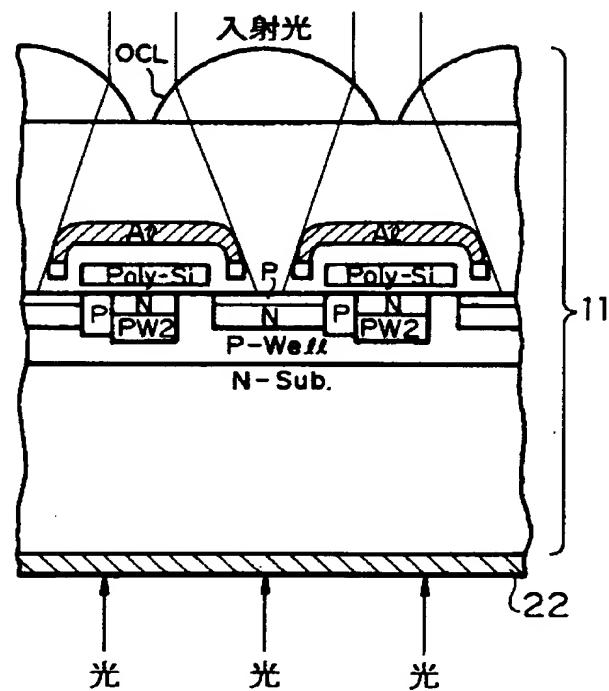
【図5】



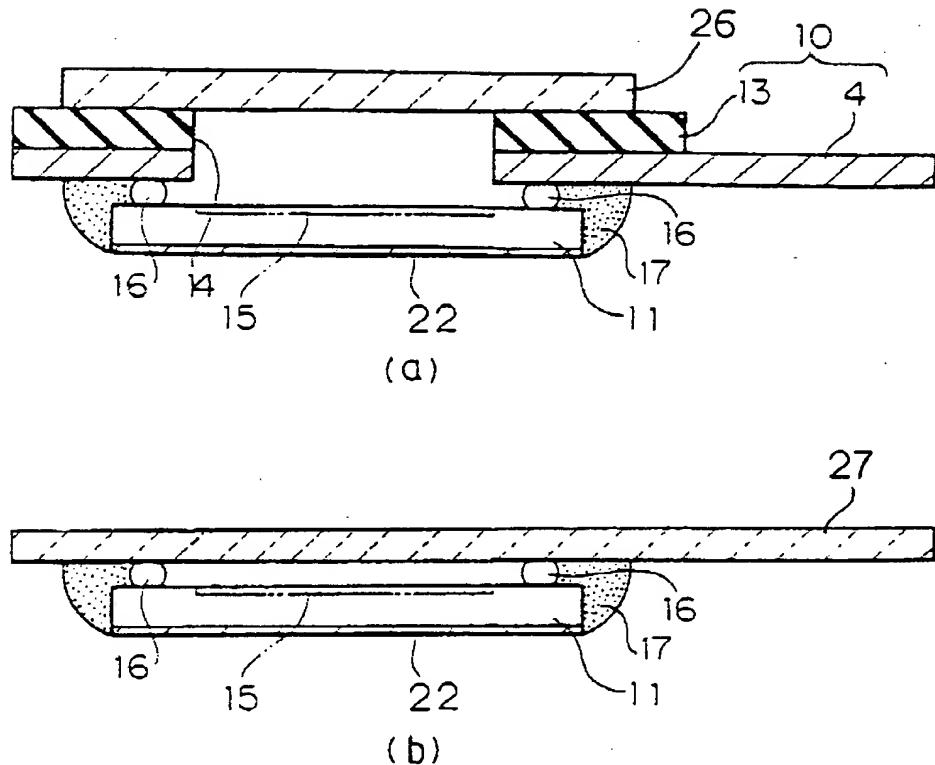
【図6】



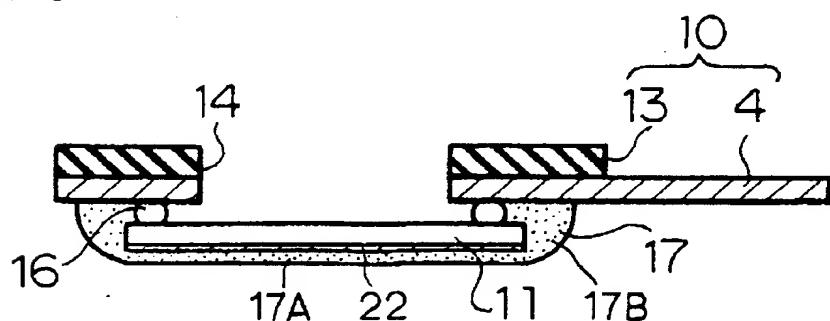
【図7】



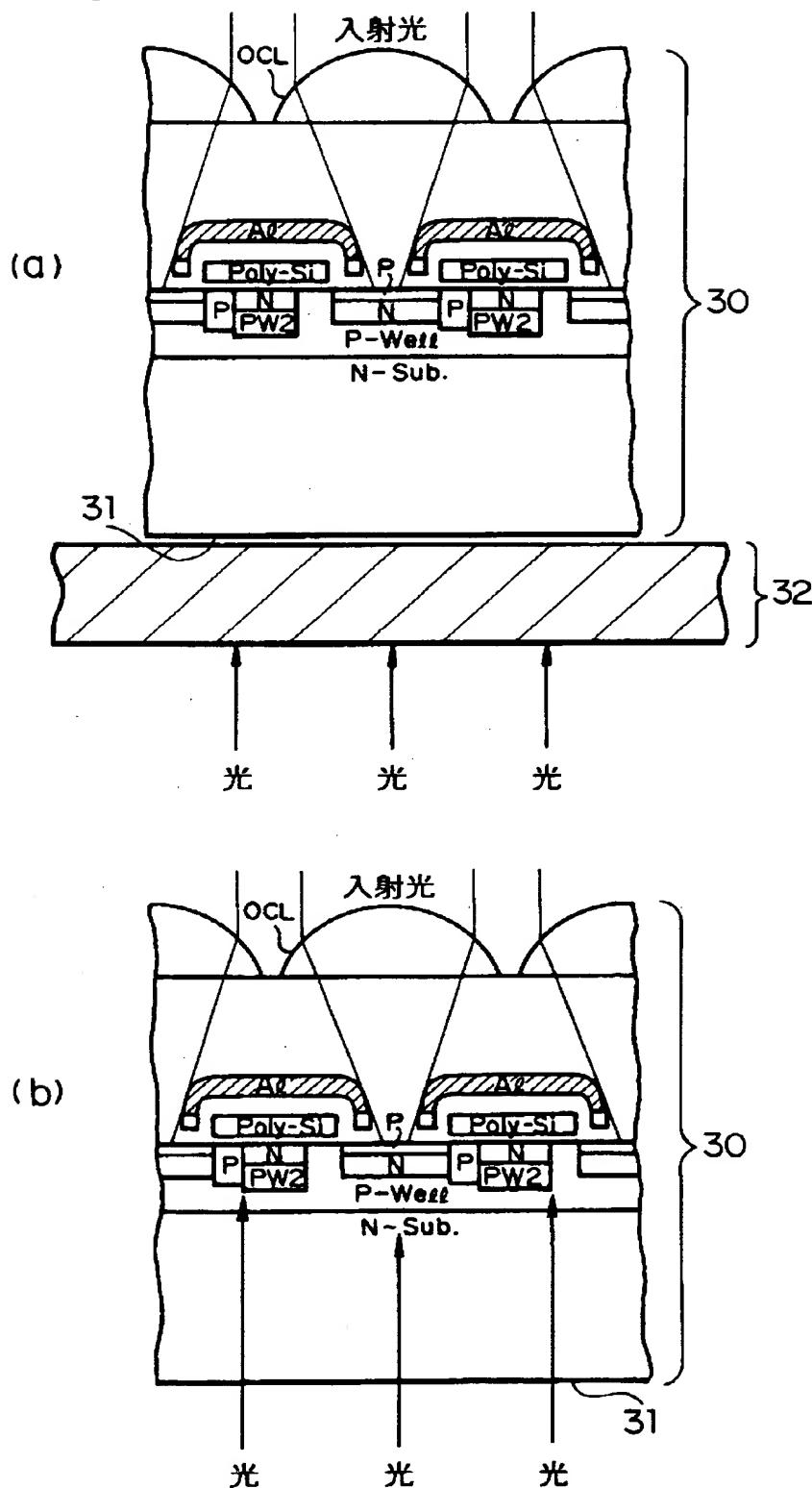
【図8】



【図9】



【図10】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 カメラモジュールの薄型化に伴う動作上の不具合（ゴースト像の発生）を解消する。

【解決手段】 透光用の貫通穴14が設けられた基板10と、一方の面に受光部15を有するとともに、この受光部15を貫通穴14から露出させた状態で基板10の一方の面にフリップチップ実装され、かつ受光部15と反対側の素子裏面に遮光膜22を有する撮像素子11と、基板10の他方の面に実装されたレンズユニット12とによってカメラモジュール2を構成する。

【選択図】 図2

出願人履歴情報

識別番号 [000002185]

1. 変更年月日 1990年 8月30日

[変更理由] 新規登録

住所 東京都品川区北品川6丁目7番35号

氏名 ソニー株式会社